

2011年度 第1回「P&I」・「E&S」共催シンポジウム 「プリンタブルエレクトロニクス 現状と将来展望」

主催 : (社)日本印刷学会 技術委員会・P&I 研究会、E&S 研究会共催
協賛 : 高分子学会、日本化学会、応用物理学会、色材協会、日本写真学会、日本画像学会、
画像電子学会、有機エレクトロニクス材料研究会、フォトポリマー懇話会、日本印刷産業連合会、
日本印刷産業機械工業会
日時 : 2011年5月24日(火)10:00~18:00(受付開始 9:30)
会場 : DICビル 17階大会議室 〒103-8233 東京都中央区日本橋 3-7-20 (JR 東京駅 八重洲口 徒歩5分)

開催趣旨

P&I(パターンニング & イメージング)研究会と E&S(エレクトロニクス & スクリーンプリンティング)研究会の共催で、プリンタブルエレクトロニクスの現状と将来展望と題して、最近各所で話題となっているプリンタブルエレクトロニクスの最新の技術と、応用分野の現状と将来展望について、第一線で活躍されている講師をお招きして、お話しいただきます。名刺交換会として、講師との、あるいは参加者どうしの接触の機会を提供いたしますので、情報収集、人脈形成にご活用ください。

プログラム

- 1. 10:00~10:50 高精度スクリーン印刷技術** 日立製作所 牛房信之
電子ディスプレイ、有機EL照明、太陽電池、有機半導体デバイスなどへの応用として、近年再認識されているスクリーン印刷の現状について、特に高精細化において重要な技術要素について解説いただきます。
- 2. 10:50~11:40 微細回路形成印刷法** パナソニックファクトリーソリューションズ 田中哲矢
回路パターンを形成する従来法に代わる新しい印刷工法を解説いただきます。この新印刷法の実現により、微細回路パターン形成の重要な項目であるアスペクト比、解像再現性、寸法精度、生産性、単純コストのすべての項目に対して従来のギャップ印刷法やフォトリソグラフィ法と比較して優位性をもつ。
- 3. 11:40~12:30 ファインライン印刷用スクリーンメッシュ** アサダメッシュ 諸富 康宏
スクリーン印刷の高精細化において重要な役割を果たすスクリーンメッシュの技術的な進歩と現状の課題、今後について解説いただきます。タッチパネル用パターンニングなどの応用についてもご紹介いただきます。
- 休憩12:30 ~ 13:30 -----
- 4. 13:30~14:20 水なし平版とプリンタブル・エレクトロニクス ~剥離オフセット印刷への取り組み~** 東レ 後藤 一起
水なし平版を利用したプリンタブル・エレクトロニクスへの取り組みについて、特に、最近、水なし平版の特徴を生かしながら、全く新しいコンセプトでL/S=5 μ m/5 μ mという高精細印刷を可能とした“剥離オフセット印刷”などを紹介させていただきます。
- 5. 14:20~15:10 新規透明導電パターン形成法** 千葉大学 星野 勝義
千葉大学星野勝義教授により開発された新規な透明導電膜材料とそのパターンニング方法ご紹介をいただきます。
- 休憩15:10 ~ 15:25 -----
- 6. 15:25~16:15 真空印刷技術** サンユレック 石川 有紀
半導体封止や半導体パッケージ及び基板等の微細孔への導電及び絶縁ペースト充填などに用いられる真空印刷技術の原理や応用について解説いただく。
- 7. 16:15~17:05 反転印刷技術(仮題)** 光村印刷 三瀬 幸吉
膜厚均一性やパターン精度、表面平滑性に優れ、有機ELディスプレイ、カラーフィルタ等への応用が検討されている反転印刷法の原理と将来展望について解説いただきます。
- 8. 17:05~17:45 名刺交換**

定員 : 80名
参加費 : 会員・協賛団体会員 10,000円、教職員・シニア 8,000円、学生 3,000円、非会員 13,000円
申込先 : (社)日本印刷学会 〒104-0032 東京都中央区新富1丁目16-8
E-Mail: nijspst-h@attglobal.net FAX: 03-3552-7206 TEL: 03-3551-1808
申込方法 : Web登録をお願いします。<http://www.jspst.org/>、セミナー・講座・シンポジウム、本シンポジウムを選択。
聴講者氏名、所属、連絡先、会員の有無を明記してEメールまたはファックスで申し込みでも結構です。
支払いは当日受付でお願い致します。定員がありますので、お早めにお申し込みください。
お断り : 事情によりプログラムまたは講師を変更する場合があります。